# 強制対流熱伝達に及ぼす周囲の影響

相場真也

Influence of surroundings for heat transfer in forced flow

- in case of a cylinder - (1st Report)

Sinya Азва

# 1緒 言

強制対流下において,流れに直角に置かれた単円柱の 表面からの熱伝達については,すでに多くの研究がなさ れている。しかし,大部分の研究は流体力学的に理想的 な流れの場におけるものであり,周囲の条件を含めたも のは比較的少ない。

筆者は,流れに対して直角に,しかも水平面内に同直 径の円柱をおき,流れに向って前方の円柱の表面からの 熱伝達への後方円柱による影響を調査し,以下に述べる ような結果を得たので報告する。

### 2 実験方法及び装置

### 2・1 熱伝達率の測定

実験は 250 mm  $\phi$ の断面をもつ風洞を用い,図1のよ うに,流れに直角に外径 26 mm  $\phi$ のビニール管を2本 平行におき,流れに向って前方の円柱(以下供試円柱と いう)に厚さ50 $\mu$ ,巾20mm,長さ424mmのステンレ ス箔をら線状に5回巻き,通電加熱し,熱流束一定の条 件で放熱せしめた。表面温度はステンレス箔の裏面に直 径 0.065 mmの Cu—Co 熱電対を接着し測定した。なお 測定は3巻きめのニクロム箔,すなわち,中央のニクロ ム箔の位置で,おこなった。また,管内は石綿で充塡し た。



昭和46年1月

他方の円柱(以下干渉円柱という)は供試円柱と同直 径で,加熱はしなかった。

## 2・2 圧力分布の測定

供試円柱と干渉円柱間の距離Lによって,圧力分布, 抗力係数がいかに変化し,また熱伝達率の変化との関係 を調べる目的で,円柱まわりの圧力を測定した。すなわ ち,上記風洞で外径  $26 \text{ mm}\phi$ の黄銅製の供試円柱に直径  $1 \text{ mm}\phi$ の測定孔を設け,円柱を  $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$ づつ回転させ て,表面の圧力を測定した。なお,干渉円柱は外径26 mm $\phi$ のビニール管を用いた。

#### 3 実験結果

#### 3·1 熱伝達率の整理

供試円柱表面温度を角度 15°間隔で測定し,主流温度 し との差を求め,GIEDT等による方法で局所熱伝達率αθを 求めた。

すなわち,図2に示したように,ステンレス箔の微少 長さの定常状態における熱収支を考えると(1)式が成立す る。

 $q_{cond}/A$  /  $(t_w - t_\infty)$  ..... (2)

(2)式で, eはステンレス 箔の 巾, sは厚さである。また, gradは (3)式より求められる。

$$q_{rad} = \epsilon \cdot \sigma \left\{ \left( \frac{T_w}{100} \right)^4 - \left( \frac{T_\infty}{100} \right)^4 \right\} \dots (3)$$

しかし, qradの値は微少であるので,数値計算を行う さいには省略した。また,Aはステンレス箔の伝熱面積 で,0.00848 m<sup>2</sup> であった。また, qcond はビニール管内

也





部への伝導熱量であるが、予備実験の結果、供給熱量の 2%程度だった。なお、 $\frac{d^2t}{d\theta^2}$ は実験により温度分布を 測定し、計算により求めた。

3・2 圧力分布と抗力係数の整理

圧力係数 CPを(4)式で定義し,圧力分布を表示する。 抗力係数 CDは,圧力分布にもとづき(5)式で整理した。

 $CP = (P - P_o) / \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot u^{2} \infty \qquad (4)$  $C_D = \frac{\pi}{180} \int_{0}^{180} CP \cdot \cos^{9} \cdot d\theta \qquad (5)$ 

3.3 実験結果



干渉円柱をおかない単円柱の平均熱伝達率の測定結果 を図3に示す。 図には HILPERT<sup>2)</sup>の実験結果をも併せ 示したが,それよりはやや高い熱伝達率となっている。 なお,図4に局所値の測定結果例を示す。

次に干渉円柱を供試円柱の後方においた場合について 述べる。

Re = 2.5×10<sup>4</sup> を一定にして,2円柱間の距離Lを種



々変化させた場合の平均スセルト数 Num と抗力係数 CDの変化を図5に示した。

図から明らかなように、干渉円柱がある場合の抗力係 数 CD の値は、2 円柱間の距離Lの大小にかかわらず、 ほぼ、単円柱、すなわち、L/d= $\infty$ の CD 値より大とな っているが、L/dによりかなり 変化 する。すなわち、 L/d=1.0 附近を 境にして、CD の値は特に 変化 し、 L/d>1.0 では小さな変化があるものの 単 円柱の CD に かなり近い 値に なり、L/d<1.0 では、L/d=1.0~ L/d=0.4 附 近までLを小にしてゆくと、CD は急増 し、L/d=0.4 の CD は単円柱のそれより約19%大きな 値となっている。またこの範囲で L/d=0.2 附近に極 小値が存在するが、単円柱の CD よりは大きい。

なお,図6に圧力分布を示す圧力係数 CP の L/dによ る変化例を示した。図で抗力係数 CD が単円柱,すなわ ち,L/d=∞の場合とほぼ同じ値を示した L/d=1.5の

秋田高専研究紀要第6



5





6

場合の圧力分布を示す曲線は、単円柱のそれとあまり変 らないが、L/d = 0.7, L/d = 0.4の曲線は、ほぼ $\theta =$ 60°附近から後方において、CPが小となっていることが わかる。しかし, 圧力分布曲線の形状そのものの大きな 変化はみられない。また、図5において、平均ヌセルト

昭和46年1月

数 Num は単円柱の場合と比較して総じて低い値となっ ているが,抗力係数 CD と同様,L/d によりかなり変化 している。すなわち, L/d>1.5 場合は, ほぼ単円柱の それに近い値になっているが,L/dが 1.5 より小さくな るに従って, Num も小となってゆき, L/d = 0.4 附近 が極小となり、単円柱の場合より約12%低い Num とな っている。L/d を再に 小にすると, 再び Num が増加 し,L/d=0.2附近で極大となるが,単円柱のそれに比 較すると小さな値となっている。

以上のことから、CD と Num の間には、一方が増加 すれば他方が減少、他方が増加すれば一方が減少という ような関係があることがわかる。すなわち, L/dをほ ぼ1.5より小にしてゆくと,抗力係数は増大してゆく が,熱伝達率は減少してゆき,L/d=0.4附近でCDは 極大,Num は極小となる。さらに, L/d を小にしてゆ くと、CD は減少し、Num は増してゆき、L/d=0.2附 近で CD は極小, Num は極大となる。さらに L/d を小 にすると、CDは再び増加し、Numは再び減少する。

次に局所ヌセルト数 Nut の L/d による 変化の 例を



図7に示す。抗力係数が単円柱の場合とほぼ同じだった L/d=1.5の Nue の変化は、やはり単円柱の Nue の変 化と大差ない。これに対して抗力係数の大となったL/d = 0.7,  $L/d = 0.4 \sigma$  Nu $\theta$  の変化は、約 $\theta = 0^{\circ} \sim 75^{\circ}$ ま では単円柱の場合のそれと大きな差はないが、 $\theta = 80^{\circ}$ 

相

以降において干渉円柱の影響があらわれている。圧力分 布への,干渉円柱の影響が $\theta = 60^{\circ}$ 以降にあらわれてい たことを考えると約 20°のずれがあることがわかる。





なお、L/dによる影響を、もっとも受けると考えられる $\theta = 180^{\circ}$ の局所ヌセルト数の変化を図8に示すが、NumのL/dによる変化と、ほぼ同様の傾向があると云える。

以上,干渉円柱による,供試円柱の熱伝達への影響を 述べたが,Lによっては,供試円柱後方( $\theta = 80^{\circ}$ 以降)の熱伝達がかなり悪くなることがわかった。このこ とは供試円柱と干渉円柱間に死水領域が形成され,主流 との間の熱移動がある程度妨げられることによると考え られる。しかし,この領域の内部においては,非定常的 な流れが複雑に入りくんでいて,2円柱間の距離によっ ては熱伝達がよくなる場合もある。しかし,単円柱の場 合よりは総じて熱伝達が悪くなっている。

## 4 結 冒

強制対流下にある円柱表面からの熱伝達,及び圧力分 布への,後方に同径の円柱をおいた場合の影響を測定 し,Re=2.5×10<sup>4</sup>の場合において,次のような結果を 得た。

- (1) 抗力係数は、単円柱のそれより一般に大となり、 しかも、2円柱間の距離によって変化し、とくに L/d=0.4附近では単円柱の抗力係数より約19%高 い値となった。
- (2) 平均熱伝達率は、2円柱間の距離によって変化するが、単円柱のそれより一般に小さく、とくに、 L/d=0.4附近で極小となり、単円柱の平均熱伝達率より約12%低い値となった。
- (3) 抗力係数の変化と平均熱伝達率の変化は、互に逆になっていて、L/dの変化により一方が増加すれば他方が減少、他方が増加すれば一方が減少となるような関係があることがわかった。

- 真 也
  - (4) 局所値の場合は, 圧力分布で, ほぼ θ = 60°以
    降,局所熱伝達率で, ほぼ θ = 80°以降に, とくに
    干渉円柱の影響があらわれる。

最後に本実験装置の製作に協力戴いた本校保坂新英氏 に感謝の意をあらわします。

5 記 号 説 明

i:ステンレス箔を流れる電流(アンペア) R: // の単位長さの抵抗(オーム) λp:ビニール管の熱伝導率 (kcal/mh°C) s:ステンレス箔の厚さ(m) e: // の巾 (m) t:温度  $(^{\circ}C)$  $\alpha_{\theta}$ :局所熱伝達率 (kcal/m<sup>2</sup>h<sup>o</sup>C) Grad:ステンレス箔からの放射熱量 (kcal/h) A:ステンレス箔の面積 (m<sup>2</sup>) qcond:ビニール管への熱伝道量(kcal/h) r:円柱半径 (m) θ:供試円柱の前方よどみ点からの角度 ( °) ε:放射率 σ:ステファンボルツマン常数(kcal/m<sup>2</sup>h<sup>°</sup>k<sup>4</sup>) Tw:表面温度 (°k) T∞:主流温度 (°k) CP: 圧力係数 P: 圧力 (kg/m<sup>2</sup>)  $P_0: "(")$  $\rho$ : 密度 (kg-sec<sup>2</sup>/m<sup>4</sup>) u∞:主流速度 (m/sec) CD:抗力係数 Num =  $\frac{\alpha_{m} \cdot d}{2}$ : 平均ヌセルト数 am:平均熱伝達率(kcal/m²h°C) λ: (t∞+tw)/2の空気の熱伝道率 (kcal/ mh°C) d:円柱直径(m) L:円柱間の距離(m)  $Re = \frac{u \cdot d}{v}$ : レイノルズ数 ν: (t∞+tw)/2の空気の動粘性係数(m<sup>2</sup>/sec)  $Nu\theta = \frac{\alpha_{\theta} \cdot d}{2}$ :局所ヌセルト数 字 ∞:主 流 w:表面 考文献

 W·H·GIEDT, BERKELEY, CALIF, Trans. ASME, Vol. 71-4 (1949), 375

添

 HILPERT: Forsch, Gebiete Ingenieurw., 4 (1933), 215

秋田高専研究紀要第6号